

## OCP 시스템의 In Silicon 장비 솔루션 – 단순한 추적 기능을 넘어

**Dr. Neal Stollon, HDL Dynamics**

In-Silicon 장비 기반 분석은 OCP(Open Chip Protocol) 기반의 시스템 통합을 쉽게 이해할 수 있는 효과적인 방법입니다. 시스템 수준에서의 신속한 분석은 응용 프로그램의 조기 시장 진입에 있어 가장 중요한 부분이며, 무엇보다 에뮬레이터, 프로토타입 및 제조 실리콘에 대해 온칩 분석 방법을 사용하면 시뮬레이션만 사용해서는 얻기 힘든 정보 및 제어력을 확보할 수 있습니다. 시스템 장비에는 임베디드 신호의 제어, 추적 및 디버그 전용 IP 하위 시스템이 포함되어 있어, 시스템 인터페이스와 작업을 보고 제어할 수 있습니다. 시스템 장비는 프로세서 실행 컨트롤과 함께 실행되고 인터페이스 및 다른 IP 디버그 시스템을 추적할 수 있기 때문에 이를 통해 온칩 작동에 대해 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 온칩 시스템 분석 기능을 사용하면 OCP 인터페이스에 대한 멀티 사이클 작업의 성능과 공유 인터페이스 및 주변 장치의 전체 하위 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다. 복합 아키텍처에는 성능과 전반적인 시스템 작업에 직접 영향을 줄 수 있는 아키텍처 초기화, 지연 및 교착, 전송 효율성, 대기 시간, 포화도, 리소스 충돌 및 다른 버스 작업에 영향을 주는 여러 가지 장단점이 있습니다. 이 수준에서 분석을 하려면 OCP 매개 변수를 구성하고 구성 결과가 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 주 신호를 보고 제어할 수 있어야 합니다. 임베디드 OCP 인터페이스의 경우 시스템 작업을 중단시키거나 시스템 작업에 영향을 미치지 않으면서 장비를 사용하여 버스 신호를 충분히 볼 수 있어야 하며, 매개 변수를 간단하게 직접 수정할 수 있어야 합니다.

전체 기사를 보려면 다음을 참조하십시오.

[http://www.ocpip.org/pressroom/articles/Recently\\_Published\\_Articles/OCP\\_Transactor\\_Article\\_6\\_19\\_2007.pdf](http://www.ocpip.org/pressroom/articles/Recently_Published_Articles/OCP_Transactor_Article_6_19_2007.pdf)

-----